

ITO 乾燥膜生成実験レポート(C_LIQ)

OPCドラムの表面にITO膜を付ける実験を行いました。これは、その第一報です

実験は、次の順で作業をしました。

- ① 先ず、OPCドラムの電気特性を測定しました。
 - DD ……図1
 - EV (PIDC) ……図2
 - HV ……図3
- ② ITO膜をOPCドラム表面に生成しました。
ITO膜の抵抗値は、1MΩ程度です。
- ③ 約1時間放置後にアルコールにてITO膜を除去し、電気特性を測定しました。
 - DD ……図4
 - EV ……図5
 - HV ……図6

結果、変化の無い事が確認出来ました。今後も折に合わせて同様の検証を行います。

この実験では、OPCドラムの表面にITO分散液を塗布し、乾燥をさせただけでITO膜をドラム表面に作る事が出来、さらに、アルコールで除去できる事がわかりました。

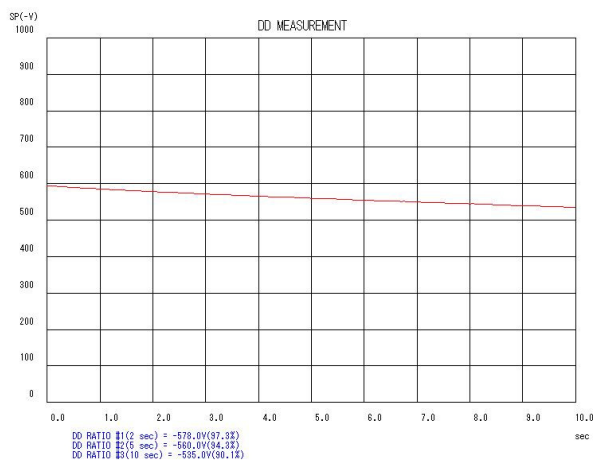
今後、この膜の利用方法について研究を進めていく予定です。

先ずは、C_LIQの電極として様々な測定を試みるつもりです。

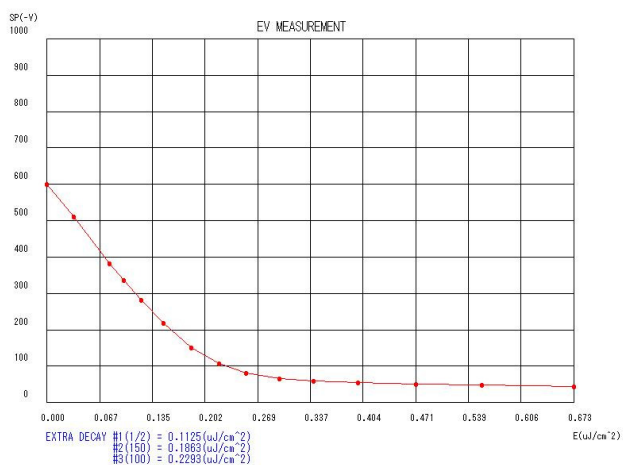
尚、OPCドラム面に生成したΦ5mmの電極の写真を掲載しました。

GENTEC

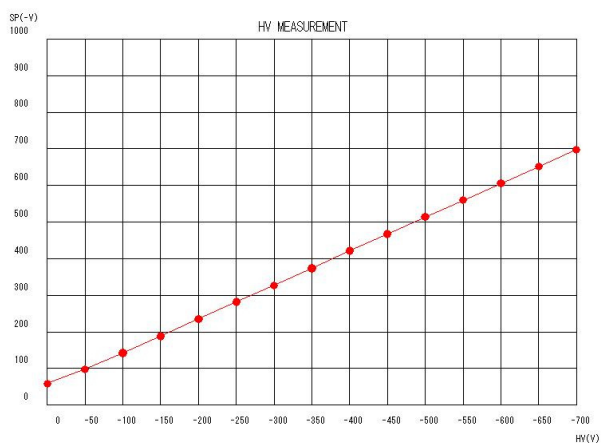
DD . . . 図 1



EV (PIDC) . . . 図 2

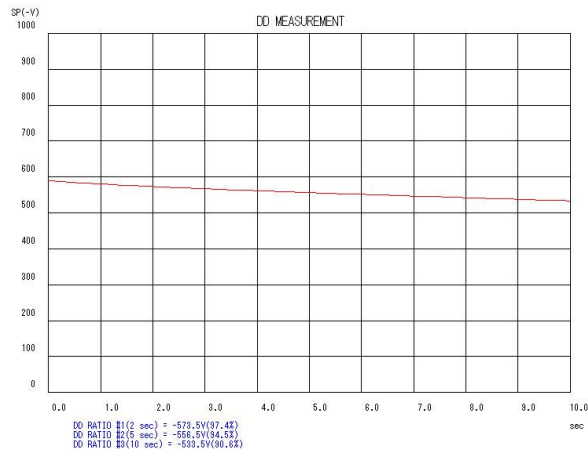


HV . . . 図 3

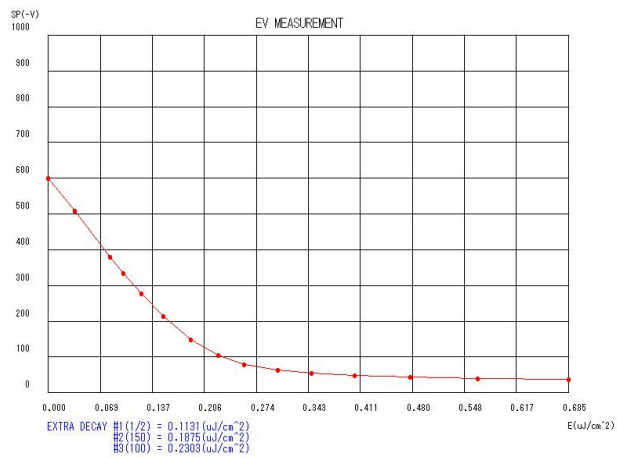


GENTEC

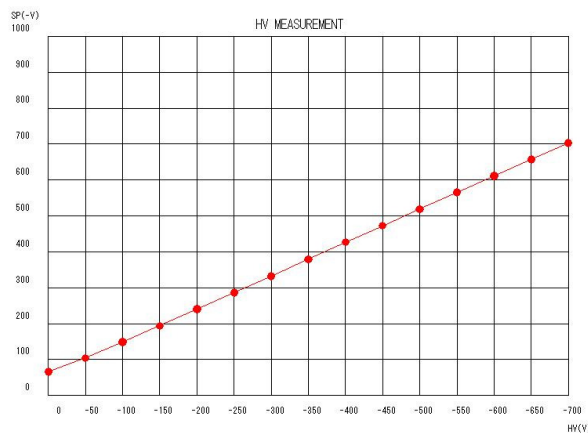
DD . . . 図 4



EV . . . 図 5

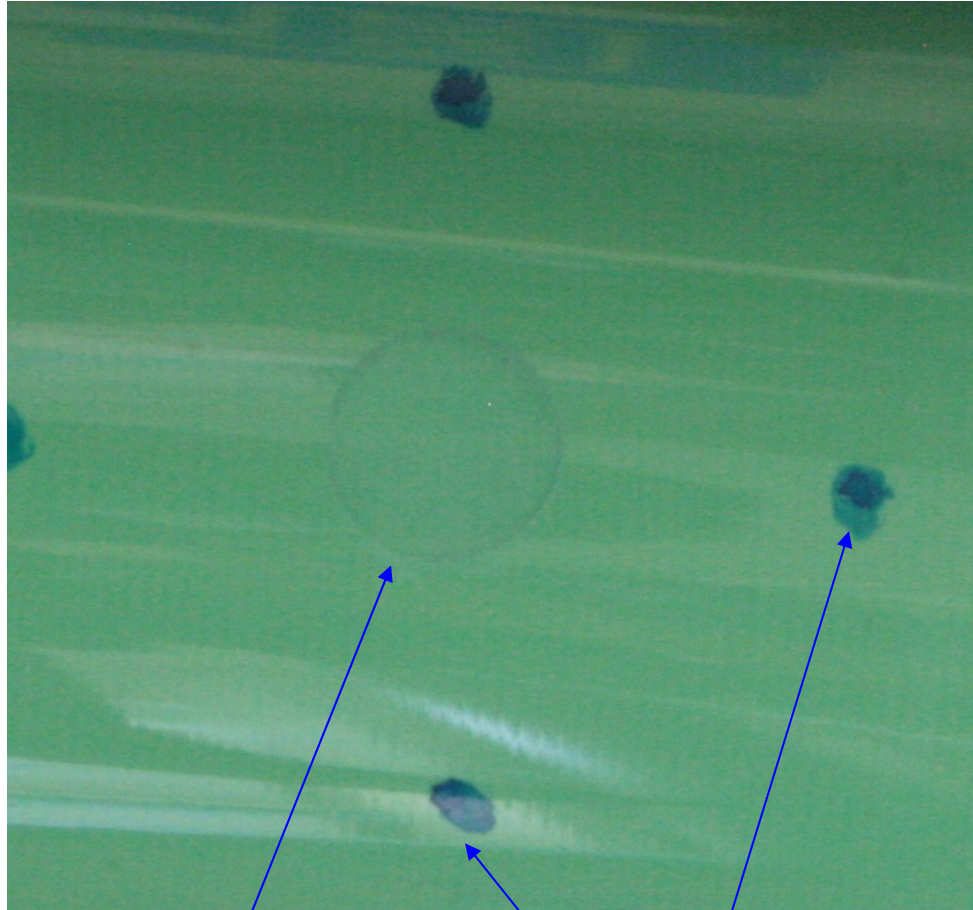


HV . . . 図 6



GENTEC

Φ 5 ITO膜の写真



Φ 5 ITO膜

位置マーカー (マジック)

2013/JUN/25

GENTEC